フェムト秒短パルスレーザ加工を用いた石英光ファイバへの機能埋め込み

Function embedding to silica glass optical fibers using femtosecond laser processing

12D5201 合谷 賢治

指導教授:渡辺一弘教授

SYNOPSIS

The aim of this thesis is to explore the potential of femtosecond laser microstructuring in a silica glass optical fiber in order to produce functionalized sensor element. In the first step of this work, femtosecond laser irradiation to optical fibers is experimentally demonstrated to obtain the processing condition in terms of irradiation parameters and focal conditions, for two methods of internal modification and laser drilling. Using the condition with the parameters, the fabrication of microstructures is performed to implant sensing function into optical fibers. In the fabrication using internal processing, micro voids are asymmetrically arranged along the optical axis of optical fiber by using a single shot of 210 fs pulse with a pulse energy of 4 µJ at a wavelength of 800 nm. The non-axisymmetric disposition of the micro-void array allows bending direction to be detected by observing increases and decreases in the light intensity propagated in the core. A 2 mm-long sensor element gives average sensitivities of -0.08 and +0.06 dB/mm over a 5 mm displacement range for two bending directions. For the second experiment, femtosecond laser drilling is successfully applied to fabricate a through-hole array in a multi-mode optical fiber for fiber optic in-line spectroscopic measurement, using the irradiation parameters adjusted in a pulse train of 1 kHz during 1.2 s, with a pulse width of 350 fs and a pulse energy of 15 µJ per pulse irradiation at a wavelength of 400 nm. Fabricated through holes penetrate the fiber core and work to be a sample cell for a spectroscopic measurement. The spectroscopic measurement will be shown for several liquids including dye of rhodamine 6G (R6G). Even with a single cell volume of approximately 20 pL, the absorption spectrum is appeared in the visible range centered at 530 nm which corresponds to the peak absorption wavelength of R6G.

Keywords : Femtosecond laser machining, Microstructuring, Optical fiber sensor, Micro cavity, Micro through-hole array, Directional bending detection, Spectroscopic measurement, Pico-litter sample cell, Dye absorption

1. はじめに

レーザ加工技術は、光源技術の発展、加工原理の解明、そ して新たな改質現象の発見により、その活躍の場を多岐に広 げている.特に、超短パルスレーザと呼ばれる、サブピコか らフェムト(10⁻¹⁵)秒光源の安定発振が可能な装置の開発に より、その加工技術の産業応用化は著しい進展を見せている. 超短パルスレーザは、一般的な定義としてピコ(10-12)秒よ りも短いパルスのレーザに適用され、同時に物質の衝突緩和 時間(ピコ秒程度)よりも短いパルスのレーザである.パル スレーザによる加工プロセスは、ピコ秒を境にして熱的プロ セスと非熱的プロセスに区分され、フェムト秒レーザによる 加工は非熱的加工に分類される.この非熱的加工では、レー ザ照射領域周辺の熱影響による不均一な溶融部が極限まで 抑制されるため、被加工材料の局所的な領域のみを空間選択 的に改質することができ、均一で精密さが求められる加工に その効果を発揮する.また、フェムト秒レーザは、非常に短 い時間のパルスに光を閉じ込められるため、瞬間的に超高強 度電場を容易に誘起させることができる. このような特徴を 有するフェムト秒レーザ加工は,難加工材料と呼ばれる,材 料の物理的特性や大きさに起因して加工が困難な材料の加 工方法として非常に有効である.難加工材料の具体例として, 前者はダイヤモンドのように硬度の高い鉱物やセラミック スやガラスのような脆性材料があげられ、光ファイバや薄膜 材料のように微小材料が後者になる.フェムト秒レーザを利 用した場合、前者の難加工材料に対しても比較的容易に加工 をすることが可能であるため、加工例の報告例は後を絶たな い.一方で、微小材料への加工は、その加工特性の調査や構 造体の埋め込みといった研究が多くを占めており、活発な報 告がなされている[1-5].

本研究では、このフェムト秒レーザ加工を利用して、 難加 工材料の一つである石英光ファイバの導波路中に構造体を 作製することにより、光ファイバへの機能埋め込みを行った. 光ファイバは光信号のままで安定的に光伝送できる優れた 導波路であり、その特徴からセンシングエレメントとして、 幅広い分野での応用が試みられている. その光ファイバへの 構造体を作製する手法として内部加工と穿孔加工の2種類の 加工方法を用いて行い、提案するセンサ機能の実現性及びセ

ンサ特性と同時に、構造体の作製手法について検討した.本 研究により石英光ファイバへのフェムト秒レーザ加工の特 性とセンサ特性が明らかになり, 光ファイバセンサの構造に 新たな可能性をみるものである.

本論文ではその研究成果を全6章にまとめた.第1章は, 研究背景と意義を述べる. 第2章は、フェムト秒レーザ加工 とその応用事例について述べる. 第3章は本研究で使用した 光ファイバ加工用のレーザ加工装置及び観察系について解 説する. 第4章では、光ファイバへの内部加工の特性と内部 に構造体を埋め込むことによって作製した、方向検知可能な 光ファイバセンサについて記述されている. 第5章では,穿 孔加工を応用した液体検査用センサについて言及した. 第6 章は本研究の結論である.

2. フェムト秒レーザ加工の定性的特徴

フェムト秒レーザ加工の特徴は、そのパルス幅が非常に短 いことに起因する非線形なエネルギ遷移であるため、ここで は定性的なエネルギ緩和過程とそのエネルギ緩和による熱 拡散について述べ、具体的な加工例を示す. ナノ秒レーザの パルスのように、イオンの衝突緩和時間よりも長いパルス幅 の場合、改質プロセスの初期段階において、電子とイオンは 熱的に平衡状態にあり、同じ温度経過を示すため熱的過程と なる.一方で、被加工部材の衝突緩和時間よりも短いパルス のレーザ光が照射されると, 改質プロセス初期段階において は、電子のみが励起され、定常状態のイオン温度よりもはる かに高い電子温度(熱的非平衡状態)となる.この状態を経 て、励起された電子からイオンへの急速なエネルギ緩和が起 こるため、熱拡散を抑制することが可能となる. Fig.1 (a) と(b)は、ステンレス鋼表面にレーザ照射した際の両者の

(a) With nanosecond laser (b) With femtosecond laser





SEM image of a hole drilled in a thin steel foil with 3.3 ns Fig.1 レーザパルス幅による加工の違い[6]

SEM image of a hole drilled in a thin steel foil with 200 fs





加工例を比較したものであり、(a):ナノ秒レーザを用いた 例では加工部周辺への熱影響による溶融部がはっきりと確 認できる.(b):フェムト秒レーザを用いた場合には溶融部 はほとんど認められず均一な加工形状が実現されている.

フェムト秒レーザ加工のもう一つの特徴は、パルスのピーク強度(J·s⁻¹·cm⁻²)が非常に高いために多光子吸収と呼ばれる非線形光学現象を容易に誘起する点である。一光子過程では、ほとんど吸収が生じないガラス(エネルギギャップ:9.0eV)のような透明材料の加工においても、この多光子過程を経てレーザエネルギを被加工対象に吸収させることができる。この効果により、透明なガラスにおいても加工をすることができ、照射条件を調節し集光レンズを用いれば、内部のみの改質が実現される。

3. 光ファイバ加工用光学システム

Fig.2 に光ファイバの加工に用いた加工システムを示す. 本システムは、レーザ制御装置,集光光学系,加工位置制御 用ステージから構成される.レーザ光源の基本波(800nm, パルス幅 210fs,最大パルスエネルギ 1mJ,繰り返し周波数 1kHz)は、波長変換装置を通して、第二高調波(400nm, パルス幅 350fs,最大パルスエネルギ 240µJ,繰り返し周波 数 1kHz)に変換される.レーザ光のビーム径は,集光光学 系により調整されたのちに、対物レンズにより集光され光フ ァイバへ照射される.照射位置はステージの移動によって制 御され、3 軸上に回転ステージを設けることで,光ファイバ の全方向から加工・観察を可能にした.このステージを使っ た照射位置制御によって自由度の高い加工を実現した.実験 では、レーザの照射方向とその垂直方向から加工部の観察を 行う.光ファイバに光源と光パワーメータを接続することで, 加工によって生じた光損失(挿入損失)を観察する.

4. 空洞化領域の配列による方向検知機能の付加

光ファイバ内部にボイドと呼ばれる空洞化領域を作り込 むことで光散乱現象を利用した屈曲センサの実現を試みた. さらに空洞化領域を非軸対称な配置で構造化することで, 屈 曲量だけでなく方向検知可能な屈曲センサの検証を行った [7]. まず, コア径 9µm のシングルモード光ファイバ内部に 加工を行うための対物レンズと照射パラメータの選定を行 い、本実験での照射条件を決定する.発振パラメータの選定 条件は、①光ファイバ内部のコア・クラッド境界にボイドと呼 ばれる空洞化領域の生成が可能であることと、 ②クラッド表 面の損傷が比較的小さいことである. ①の条件は, 空洞化領 域が光ファイバコアにある場合、透過光に対する散乱源とし て働くことが期待できるために設定する. ②は、クラッド表 面の損傷が機械的強度を劣化させ、屈曲センサに曲げを与え たときに光ファイバの破断の原因になってしまうため、可能 な限り避けるべきである.以上の2つの条件から、実験では 対物レンズの開口数は0.45、レーザ発振パラメータは、波長

800nm, パルス幅 210fs, 1 つのボイド当たりパルス数 1, フルエンスは 250J/cm² を採用した.光学系の調整と対物レ ンズによって,レーザ光はスポットサイズが 1.36µm まで絞 り込まれ,そのときのレイリー長は 1.81µm である.

Fig.3は、内部構造体の模式図と実際の顕微鏡画像である. 図の(a)-iに示すように、作製する構造体は光ファイバの光 軸に対して非軸対称に配列されている. 図のように構造体を 非軸対称に設計することで、光ファイバの屈曲方向に依存し て光強度が変化することが期待される.また、空洞化領域を 電子顕微鏡で観察した結果〔Fig.3(b)‐i〕, 光ファイバ内部 のレーザ集光点にボイドが生成されていることを確認した. このボイドの領域は光ファイバ光軸方向に 10µm, 長さ 2µm, 厚さ 0.2um の大きさであることを顕微鏡観察により確認し た.本実験では、センサの作製再現性、センサ感度(dB/mm) について調べるために、センサ長の異なる3種類のセンササ ンプルをそれぞれ3サンプル用意する.ボイドの配列方法は, 模式図(a)-iiと iii に示すように連結した直線状に配置し, それぞれのボイドの間隔はボイドの光軸方向の長さを考慮 して 10µm 間隔で配列し、これをセンサ部とした. サンプル S_{0.5}, S_{1.0}, S_{2.0}のセンサ長が 0.5, 1.0, 2.0mm となるように, ボイドの配列数をそれぞれ 51, 101, 201 個ずつとした.加 工と同時に各サンプルの挿入損失(加工により発生する透過 光損失)を観察するために,波長 1310nm の LED 光源とパ



Table 1 センサ長と挿入損失,光強度変化量,センサ感度

		Intensity change in bending direction A		Intensity change in bending direction B	
Sensing length (mm)	Insertion loss (dB)	Decrease (dB at 5 mm)	Average sensitivity (dB/mm)	Increase (dB at 5 mm)	Average sensitivity (dB/mm)
0.5	0.51	-0.14	-0.03	+0.04	+0.01
1	1.05	-0.20	-0.04	+0.13	+0.03
2	2.01	-0.41	-0.08	+0.27	+0.06

ワーメータを用いて光強度の変化を測定した.挿入損失を観察した結果,コア-クラッドにボイドを作ることで一つのボイド当たり 0.01dBの光損失が発生することを確認した.

測定実験では、屈曲に対する光強度の変化を観察するため に、作製したサンプルのそれぞれに対して、専用の測定ステ ージを用いて、ステージを変位(0.5mm, 0.01mm 刻み)さ せることでセンサ部に曲げを与えた. 屈曲方向は、構造体が 曲げの外側となる方向(A方向)と内側となる方向(B方向) の2方向に曲げを与えた. 測定結果を Fig.4 と Table 1に示 す. Fig.4 はサンプル S0.5~2.0 の各 3 サンプルのうちの一つを 示し、Table 1 はそれぞれのセンサ設計と挿入損失、光強度 変化(5mm 変位点)、センサ感度の平均値をまとめたもので ある. サンプル S0.5を例にとると、各方向において変位量と ともに光強度変化量が増加し、A方向の5mm 屈曲時には光 強度が 0.14dB減少し、B方向では 0.04dB 増加することを確 認した. サンプル(b)、(c)と比較し、センサ長が大きくな るほどセンサ感度が増加するという結果を得た.

実験結果から、フェムト秒レーザ加工によって作製した、 非軸対称な内部構造体を有する光ファイバセンサの実現性 及び再現性が示された.また、センサ長の異なるサンプルを 比較した結果から、容易にセンサ感度を調整可能であること を確認し、本センサの有用性が示された[8].

5. 穿孔加工による光ファイバ分光センサの作製

マルチモード光ファイバは、シングルモード光ファイバと 比べて広帯域の光伝送が可能である.この光ファイバに穿孔 加工によって、透過光に被検査試料が直接的に作用する構造 を作製し、光ファイバ中の貫通孔について、分光計測におけ るサンプルセルとしての実用性を検証した[9].

まず,光ファイバに穿孔加工する際の加工パラメータの選 定条件について述べる.選定条件は,①マルチモード光ファ イバのコア(62.5µm)を貫く深さの孔が達成されることと, ②加工孔周辺の入口と孔の途中でクラックが比較的少ない ことである. ①は,被検査液体と光ファイバコア内の透過光 との作用面積(体積)を確保するために重要である.以上の 2つの条件から,対物レンズの開口数は0.40を採用し,レー ザ発振パラメータは,波長 400nm,パルス幅 350fs,1つの 孔当たりパルス数 600,フルエンスは 600J/cm²とした.光 学系の調整と対物レンズによってレーザ光はスポットサイ ズが 1.82µm まで絞り込まれ,そのときのレイリー長は 6.50µm である.

貫通孔の作製では、光ファイバの2方向から各孔の頭頂部 を突き合わせるように穿孔加工を行うことで、貫通形状を得 た. Fig.5 に貫通孔 (セル)の模式図〔(a), (b)〕と顕微鏡 観察〔(c) - (e)〕によって得られた観察結果を示す. (a) と (b) に示すように, 光ファイバコアをセルが貫いており, 直線状に配列するようにセンサ部の設計をした. (c) と(d) の光学顕微鏡観察によって、貫通構造が形成していることを 確認し、セルの大きさがウエスト部分では 10µm、入口は 18µm という計測結果を得た. セルを2つの円錐台からなる 構造としてセル体積を計算した結果、その体積は 20 ピコリ ットルと微小な体積であることがわかった. さらにセルの内 側を電子顕微鏡に観察すると,100-500nm 程度の凹凸構造が 形成されていることを確認した.この構造は空気雰囲気下で, ガラスなどの誘電体に対して、多パルス発振で照射すると、 レーザ照射部の周囲に発生する微小な縁(リム)が幾重にも 折り重なって構造化するという実例[10]があり、この凹凸構 造も同様のものと考えられる.

本センサの有用性とセンサ特性について調べるために、セ ンサ部のセル数が1と10のセンササンプルSonとSnoを準備 した.サンプルSonとSnoの挿入損失は、それぞれ1.0と1.6dB 程度となった.測定実験は、白色光源(400-1800nm)とス ペクトラムアナライザを光ファイバに接続し、複数の被検査





液体サンプルにセンサ部を浸すだけの簡便な手法である.ま ず,屈折率センサとしての有用性を調べるために,3種類の 液体〔水(1.33),エタノール(1.36),パラフィンオイル(1.48)〕 にセンサ部を浸し、そのスペクトルの観察を行った.実験結 果から、屈折率の増加にともなって透過光強度が大きくなる ことを確認した.光ファイバの屈折率を基準にして考えると, 液体に浸していないときのセル内の屈折率が空気の 1.00 で あるのに対して、液体が侵入することで屈折率差が小さくな り、フレネル反射の影響が緩和されたためであると考えられ る. さらに, S₁₀ の場合の方が, 屈折率変化に対する応答が 直線的になり、セル数の違いによる感度の違いを確認した. つぎに、ローダミン 6G (R6G) 色素を用いた分光計測の観 察結果について述べる.液体サンプルは,R6Gエタノール溶 液の濃度が 0.17-16.5M(M: 10⁻³・mol/L)となるように調合 した.実験により得られた R6G 溶液の吸収スペクトルから, So1 と S10 のどちらのセンサにおいても, R6G の吸収ピーク 波長である530nmを中心に,色素による吸収が生じており, R6G 濃度に依存して吸光度が増加していることを観測した. So1 と S10 を比較すると、S10 はセル数が 10 倍になっている にもかかわらず, So1 の吸光度の 2 倍程度であることがわか る. ピーク波長の 530nm の吸光度について、より詳しく考 察するために, 吸光度と R6G 濃度の関係を Fig.6 に示す. 測 定実験で得られた結果 (◆) を見ると,濃度が大きくなるに つれて,吸光度が対数関数的に増加しているようにみえる. 一般的には、濃度c(mol/L)とセル長L(cm)に対する吸光 度 A, の変化は、線型的なランベルト・ベールの法則に従い、 式(1)で定義される.

$$A_{\lambda} = -\log_{10}(T) = \varepsilon_{\lambda} cL , \qquad (1)$$

ここで*T* は透過度, ϵ_{λ} (L/cm·mol) はモル吸光係数である. 濃度とセル数に対する吸光度 A_{λ} の非線形な変化を調べるために,面積とセル長の係数 $\alpha \geq \beta$ を式(1) に導入する.係数 α (<1) は,実効的な作用面積であり,光ファイバコアと セルの断面積の比で定義される. β (≤1) は実効的なセル長 の係数で,セル長 *L* を貫通セルの直径 *L* とセル数 *n*, β の積 に置き換えることで式(2) を得た.

$$A_{\lambda}' = -\log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) = -\log_{10}\left\{ \alpha 10^{-\varepsilon_{\lambda}c(n\beta L')} + (1-\alpha) \right\}$$
(2)

計算で用いた,波長 530nm におけるモル吸光係数 $\mathcal{E}_{\lambda=530nm}$ は, 10.5×10⁴ (L/cm·mol)を用いた.この計算モデルをもとにし て行った,実験結果とのフィッティングで得られた対数曲線 を Fig.6 に実線で示す.Fig.6 (S₀₁):セル数1では, (α , β)





(b) Spiral arrangement (4 cells) $[(\alpha, \beta) = (0.64, 1.00)]$





= (0.16, 1.00) を与えた場合に実験結果との良い一致が得 られた. 実際のセルの面積比 [Fig.7 (a)] はコアの 25%に 相当し、この面積比(=0.25)よりも計算モデルから得た α (=0.16) が小さいことがわかる.これは、セルの形状が円筒 であり,表面の凹凸構造により透過光が散乱されているため であると考えられる. つぎに Fig.6 (b): セル数 10 では, (a, β) = (0.26, 0.14) を与えた場合に実験結果との良い一致が 得られ、このときの α は実際の面積比(=0.25) よりもわず かに大きい値を示した.この原因として、コアの中心軸と配 列されたセルの位置不整合によるものと考えられる.また, βの値がセル数1のセンサよりも小さい原因は、配列された 10 個のセルのうち,始めのセルによって透過光のモードが乱 れ、後方のセルに入射する光が減少したためと考えられる. 計算モデルを用いた解析により、セルの実効的な作用面積は 実際の面積比よりも小さいことと, セルを並列に配列するこ とは効果的ではないことが明らかになった. これらは Fig.7 (b) で示すようにセルを螺旋的に配置することで吸光度の 向上が期待できることを示す結果である.この結果から、光 ファイバ中に作製した微小セルによって,分光計測における 有用性が示された[11].

6. おわりに

本研究では、フェムト秒レーザ加工を応用した石英光ファ イバの構造的機能化として、新たなセンサ構造を提案し、そ のセンサ特性を示した.構造体の作製は、内部加工と穿孔加 工でそれぞれ行い,そのセンサ特性の評価を行った.構造体 の作製方法、レーザ照射条件を明らかにし、方向検知屈曲セ ンサを作製するために、内部加工によって、シングルモード 光ファイバ内部にボイドを配列し、非軸対称な構造体を作製 した.2 方向の曲げに対するセンサ応答を観測した結果,屈 曲方向に依存した光強度の変化を示し、方向検知センサとし て機能することを確認した.また,光ファイバ分光センサの ために、穿孔加工を応用して光ファイバのコアを貫く孔配列 を作製した. R6G 色素を用いて吸収スペクトルを観察したと ころ, R6G の吸収ピークと一致するスペクトルが得られ,本 センサの実現性が確認された. 作製した貫通孔の体積が 20 ピコリットルであり,液体サンプルが微小量であっても分光 計測が行えていることが示された.本研究は, 選定した照射 条件を用いて行った加工実験から、光ファイバに構造体を書 き込むことを達成し、有用性のあるセンサ機能を示すことが できた.フェムト秒レーザ加工による難加工材料へのアプロ ーチは、産業応用での需要が高まっており、本研究で示した 石英光ファイバに対する内部及び穿孔加工の照射条件は、そ の一助となるものである.

参考文献

- [1] W. Watanabe, et al., Opt. Express 10, 978-983(2002)
- [2] C. B. Schaffer, et al., Opt. Let., 26, 93-95(2001)
- [3] I. B. Sohn, et al., Opt. Express 18, 19755-19756 (2010)
- [4] M. Barberoglou, et al., Appl. Surf. Sci. 255, 54, 25-29 (2009)
- [5] G. Dumitru, et al., Appl. Phys. A 74, 729–739 (2002)
- [6] B.N. Chicbkov, et al., Appl. Phys. Lett. 63, 109-115 (1996)
- [7] 特許出願:特開 2011-180133.
- [8] K. Gova, et al., The Rev. of Laser Eng., 41-9, 718-721(2013)
- [9] 特許出願:特願 2014-43340 平成 26 年 3 月 5 日.
- [10] A. B. Yakar, et al., Appl. Phys. Lett. 83, 3030-3032(2003)
- [11] K. Goya, et al., Sens. /Act. B, (Accepted for publication, Dec. 2014)